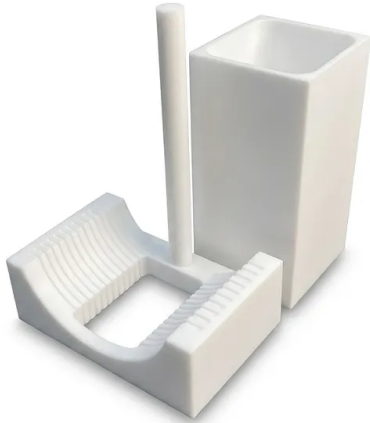


# 6英寸圆形Ptfе晶圆承载器 耐酸碱 半导体清洗花篮 可定制

货号: PL-CP55



## 简介

专为关键半导体湿法工艺设计的高纯度6英寸PTFE晶圆承载器。具有卓越的耐化学性和热稳定性，这些可定制的花篮确保在生产过程中严苛的酸性和碱性浸泡环境下，实现均匀清洗和基板保护。

## 了解更多

| 应用       | 描述                            | 主要优势                   |
|----------|-------------------------------|------------------------|
| 半导体RCA清洗 | 将晶圆浸入SC-1和SC-2溶液中以去除有机和离子污染物。 | 完全耐受氧化剂和高温碱液。          |
| 湿法蚀刻工艺   | 使用氢氟酸或磷酸选择性去除材料层。             | 精确的基板定位确保整个晶圆的蚀刻深度均匀。  |
| 光刻胶剥离    | 使用强腐蚀性有机溶剂或食人鱼溶液去除光刻胶层。       | 材料在接触强腐蚀性溶剂时不会膨胀或降解。   |
| 太阳能电池制绒  | 用于提高效率的硅晶圆大批量清洗和表面制绒。         | 耐用的设计可承受工业规模化学处理的严酷考验。 |
| CMP后冲洗   | 化学机械抛光后去除浆料颗粒和化学品。            | 超光滑表面防止颗粒重新附着，便于冲洗。    |
| 痕量分析准备   | 在浓硝酸或盐酸中清洗高纯度实验室组件。           | 为超痕量元素分析消除了交叉污染风险。     |
| MEMS制造   | 用于微机电系统生产的专用基板处理。             | 可定制的槽尺寸适应非标准基板厚度。      |

| 参数      | PL-CP55 规格                        |
|---------|-----------------------------------|
| 产品标识    | PL-CP55 圆形晶圆承载器 (花篮)              |
| 材料成分    | 高纯度原生聚四氟乙烯 (PTFE)                 |
| 晶圆尺寸兼容性 | 6英寸 (150mm) 标准 (可提供定制尺寸)          |
| 配置      | 圆形开槽花篮 / 穿孔花形设计                   |
| 槽数 / 容量 | 可定制 (标准选项: 10、25或50槽)             |
| 工作温度    | -200°C 至 +260°C (-328°F 至 +500°F) |
| 耐化学性    | pH 0-14 (通用酸/碱/溶剂耐受)              |
| 槽宽 / 间距 | 完全根据用户规格定制                        |
| 手柄类型    | 集成固定手柄或可拆卸PTFE摆动手柄 (可定制)          |
| 表面光洁度   | CNC加工光滑 (典型 Ra ≤ 0.8μm)           |
| 制造方法    | 100% 精密 CNC 加工 (定制产品)             |
| 尺寸      | 定制设计, 以适应特定的湿法工作台或槽体尺寸            |